



精密光学检测仪器

4 吋激光干涉仪

激光干涉仪采用相移技术准确表征被测表面的三维形貌，测量精度高达 0.06 μ m 甚至更高，广泛用于平面光学元件高精度检测。



优势

1. 准确测量 4 吋口径及以下的光学元件的透射波前、反射波前。
2. 测量精度和测量重复性能媲美美国 Zygo 和 4D 干涉仪。
3. 根据客户要求定制开发。

主要技术指标

项目	型号
测量方式	菲索干涉原理
移相方式	波长移相或机械移相
主机波长	632.8nm (可定制)
主相机分辨率	2048*2048
测量口径	4-inch (101.6mm)
主相机调焦能力	有
主相机采集速度	50Hz
透射平面参考镜面形误差 (PV)	$\lambda/10$
反射平面参考镜面形误差 (PV)	$\leq \lambda/10$ (可定制 $\lambda/20$)
空腔精度 (PV)	$\leq \lambda/10$, $\lambda=632.8\text{nm}$
面形误差测量重复性 (RMS)	$\leq 1\text{nm}$ (2 σ)
测量高平行度光学元件透、反射波前	支持
标准配件	计算机、条纹监视及分析软件
相干长度	1.0m (若被扩束, 此参数会变长)
工作温度要求	22°C $\pm$ 1°C
工作温度波动要求	每小时变化小于 1°C
工作湿度要求	55% $\pm$ 10%RH
防震要求	气浮平台, 固有频率: 1-2Hz
工作电压	AC 110-220V, 50/60Hz

